高精度レーザーアライメントのための 500m 長レーザー長基線の高安定化

諏訪田 剛*1,2

High Stabilization of 500-m-Long Laser-Based Fiducial Line for High-Precision Laser-Based Alignment

Tsuyoshi SUWADA *1, 2

Abstract

The development of alignment techniques is particularly essential for long linacs to stabilize the acceleration and transportation of particle beams with higher charge intensities, to preserve the beam quality and to increase the injection efficiency of the beams into storage rings. Alignment measurements with a resolution of ± 0.1 mm cannot be easily performed for long linacs (> 100 m) while conventional optical alignment systems with a high-precision telescope and a laser tracker, etc. are widely used for relatively short linacs (< 100 m). The laser-based alignment technique is an alternative method to accurately locate accelerating devices of the long linac on a straight line, where the laser beam can be used as a long fiducial straight line. Such laser-based alignment technique was implemented at the construction stage of the KEK injector linac in 1982; however, the high stabilization of the long laser-based fiducial line has not been realized even until now. A laser beam with higher stabilization has been implemented as a 500-m-long fiducial straight line for alignment measurements by the injector linac group in March 2013. We experimentally investigated the propagation and stability characteristics of the laser beam passing through laser pipes in vacuum. Pointing stability at the last fiducial point with the transverse displacements of $\pm 40 \,\mu$ m level in one standard deviation by applying a feedback control was successful results for the high-precision alignment of the injector linac currently in progress.

1. はじめに

現在 KEKB 入射器では,次期計画 SuperKEKB¹⁾ に向けた入射器増強と高度化が進行中である^{1,2)}. この中で高精度アライメントは高度化に向けた最 重要項目の1つである.先の東日本大地震による 入射器の被害は甚大であったが,迅速な復旧を経 てビームライン後半部(全長の約1/3)を利用し て放射光リングへの入射が続けられている.しか し,ビームライン前半部(全長の約2/3)のアラ イメントは大きく変位したままである.2013年 7月から夏期保守に入り復旧作業と同時に SuperKEKB に向けた入射器増強が本格的に開始 されアライメントが佳境に入った.

筆者等は 2009 年度より SuperKEKB に向けた 高精度レーザーアライメントシステムの開発を継 続してきた. この結果,最大直線部のアライメン トに必要な 500 m 長レーザー長基線の安定化に 成功した.本成果により高精度アライメントのた めの道具立てがようやく準備されたことになる. 本成果は,高精度アライメント用のレーザー長基 線としては世界でも最長クラスである.

アライメントの光軸となる長基線には He-Ne レーザー(10 mW)を用いた.長基線を安定化さ せるために新たなレーザー光学系を構築し,さら に計算機制御によるフィードバックを導入するこ とで光軸の入射角度に対する安定性を飛躍的に高 めることに成功した.この結果,500 m 長直線部 の終端における光軸の位置安定性は40 μm(1σ) レベルとなり入射器アライメントに要求される精 度を満足することを検証した.本成果は,入射器 のみならず次世代の長距離線形加速器にも充分応 用可能な技術である.

^{*1} 高エネルギー加速器研究機構 KEK, High Energy Accelerator Research Organization

⁽E-mail: tsuyoshi.suwada@kek.jp)

^{*2} 総合研究大学院大学 The Graduate University for Advanced Studies School of High Energy Accelerator Science

2. 入射器におけるレーザーアライメント

2.1 入射器増強の概要

SuperKEKB ではリング衝突点において鉛直方 向にナノメートルサイズ ($\sigma_y \sim 60 \text{ nm}$)までビー ムを絞り電子と陽電子を衝突させるナノビーム衝 突機構が採用された¹⁾. これは極めて野心的な機 構で KEKB に比べ衝突ルミノシティを 40 倍にも 向上させることを目標とする. このことでビーム 寿命 (~10 min) の大幅な低下が避けられなく なり入射ビームの大電流化と高輝度化が要求され た. **表1**に SuperKEKB における電子及び陽電子 入射に要求されるビームパラメータの仕様をまと める.

入射器では、入射ビームの要求仕様を満たすた めに次の三つが最重要項目として現在開発が進行 中である.(1)電子に対し従来の熱電子銃からレー ザー RF 電子銃に変更し大電流と低エミッタンス 化を同時に行う、(2) 陽電子に対し陽電子源の収 束磁場を強化し、かつダンピングリング(DR)

表1 SuperKEKB における入射ビームの諸元表¹⁾

ビームパラメータ	要求仕様	
	電子	陽電子
エネルギー [GeV]	7	4
バンチ電荷 [nC]	5	$4/10^{*}$
加速バンチ数	2	2
エミッタンス (γε)[μm]	20	10
エネルギー広がり [%]	0.08	0.07
バンチ長 [mm]	1.3	$0.5^{#}$

* 陽電子生成用1次電子ビームの電荷量

[#] DR 出射後にバンチ圧縮をする場合

を新設することにより高輝度化を図る,(3) 500 m 長直線部の高精度アライメントである.達 成目標は KEKB の仕様に対し電流量で4~5倍, エミッタンスで15~200分の1である. SuperKEKB では,入射ビームの長距離にわたる 安定した加速・輸送を行うにはウェーク場の適切 な抑制と高度なビーム制御が必要となる.高精度 アライメントは,入射ビームに対する高度なビー ム制御を行う上で欠かせない技術である.詳細な シミュレーション計算によると要求されるアライ メント精度は100 µm(1 σ)である.

2.2 アライメントの概要

入射器は, 180 度偏向部 (エネルギー 1.7 GeV) を挟んで 2 本の直線部(125 m 長 AB ライン及び 475 m 長 C5 ライン)からなる総長 600 m の電 子陽電子線形加速器²⁾ である(図 1). 各直線部 の最上流にはレーザー光源を置き, 独立してアラ イメントを行うことができる.

入射器は8つのセクター(76.8 m 長)から構成され,各セクターは基本的に8台の加速ユニット(9.6 m 長)から構成される.加速ユニットには,耐震構造を有する8.44 m 長の円筒型架台(外径508 mm,肉厚7.9 mm,鉄/SGP500A,SS400相当品)が設置される(図2).架台上には4本の2 m 長 S バンド加速管が搭載される.架台内面上部にはレーザー光軸管(外径114.3 mm,肉厚3 mm,ステンレス鋼/SUS304TP 60A-10S)が平行して挿入され溶接により固定される.架台と光軸管は二重同軸構造を形成し,環境の変化に対する光軸管の軸方向の温度変化が緩和されるようにしている.レーザー光の反射や散乱を抑制す



図1 KEK 入射器のビームライン全体配置図とアライメント用レーザーの輸送路(赤線)



図2 加速ユニットの機械図面.a:上面図,b:側面図,c:正面図.

るために光軸管の内面には黒色塗装を施している.

隣り合う架台間は同一径の単管がフランジ接続 され,光軸管の始点及び終点には真空窓としてそ れぞれ 20 mm 及び 15 mm 厚の合成石英を装着 している.500 m 長に及ぶ光軸管全体は,2 台の 1000 *l*/min スクロールポンプ(AB ラインは 1 台) で真空が保持される.到達真空度は,引き始めか ら約 18 (8)時間を経て C5 (AB) ラインでは 4 (3) Pa 程度である.光軸管の真空保持は光軸の安定 化には必須である.

長さの異なる変則的な架台を含み計 48 台の加 速ユニットが直線上に並び C5 ライン直線部を構 成する.一方, AB ライン直線部には計 12 台の 加速ユニットが直線上に並ぶ.

光軸測定用の四分割型シリコンフォトダイオー ド(QPD: Quadrant silicon Photo-Diode, 直径 10 mm)が中心に装着された QPD ホルダーがフ ランジを介して加速ユニットの両端に接続される (図3). ホルダーと架台との接続は隙間嵌めとし, 嵌め合い公差は φ 130 (-0.043/-0.068) mm で ある. レーザー光の反射や散乱を抑制するために 光軸管のみならずホルダー内面にも黒色塗装を施 している.

入射器のレーザーアライメントシステムは 30 年以上も前の建設時に整備されたものである.本 研究では、レーザー光学系の新たな導入を省き, 放射線損傷した QPD の交換や光軸管の真空リー クの修復を経てほぼそのまま再利用している.結 果として全体の約 1/3 (70 台)に相当する QPD センサーの交換を余儀なくされた.交換時のホル ダー中心に対する QPD の取り付け精度はアライ メントの誤差要因となるが、本研究を通して高精 度な取り付け手法を新たに開発した³.

レーザーアライメントでは,加速ユニットの両 端に設置した QPD にレーザーを照射しその強度 重心を計測することで加速ユニットの光軸に対す る変位を測定する.この原理に基づき光軸からの



図3 光軸測定用の四分割型シリコンフォトダイオード. QPD はサブホルダーの中心に装着される. 右手に見えるレバー(蝶番)を手動で回転させる とサブホルダーが回転し QPD が直立(又は倒立) する. ホルダー内径: φ 130 mm.

変位量がゼロとなるように加速ユニットの変位を 機械的に調整する⁴⁾.

一方,加速ユニット上の加速管に対しレーザー トラッカーを用いて局所的にアライメントを行 う. この計測には、ターゲット用の基準座が必要 となる. これには専用の QPD 基準位置取り出し ジグを用いて、QPD を利用して基準位置を移す ことで基準座の位置が高精度に決まるようにして いる. ジグは QPD ホルダーに隣接して嵌め合い 構造によりフランジ接続され、加速ユニットに対 し直角横方向にアーム状(400 mm 長)に張り出 している。基準座をこのジグの先端部に設けてい る、トラッカーによる計測では、加速ユニットの 両端に取り付けたジグ先端の基準座にターゲット を置き、ターゲット間を結ぶ直線を基準線として 加速管のアライメントを行う.基準座の加工精度 は、三次元形状測定により ± 20 µm(1σ)レベ ルであることが検証されている.

このように、入射器のアライメントは、加速ユ ニットに対する長距離アライメントとユニット内 加速管に対する短距離アライメントという二段構 えのアライメントからなる.両者は独立して実施 することが可能である.加速ユニット間には四重 極電磁石(Q電磁石)が搭載された専用架台が設 置される.専用架台の変位は長距離アライメント で調整され,Q電磁石の変位は短距離アライメント

これまで余り注意が払われてこなかった光軸の

安定化は、レーザーアライメントにおいては極め て重要である.単純に 500 m 長にわたるアライ メント精度を 100 µm とすると光軸の角度安定性 は 0.2 µrad が必要である.このような微小角度 の変化は高精度傾斜計でも測定は困難である.開 発当初,500 m 長の光軸安定化の困難さは想像も できなかった.このように,これまでの筆者等の 努力は如何にして光軸を安定化させるかというこ とに尽きる.

2.3 レーザー光学系

前任者のシステムを引き継いだ2009年当初は、 レーザー光源の放射線損傷を危惧した結果. クラ イストロンギャラリーに光源を置き、光ファイ バーを通してレーザーを加速器トンネル内へ引き 入れるというシステムであった. ファイバーから 出射するレーザーを適度な倍率で拡大した後、光 軸管に入射させるという構想である.本構想に従 い光ファイバーから出射するレーザーを通常の光 学系に伝送させるために様々な試みを行ったが全 て失敗に帰した⁴⁾.ファイバーからレーザーを取 り出す光学系にばかり気を取られ光学系全体を如 何に堅牢に安定化させるかということ、さらに光 軸の簡便な調整機構の構築まで気が回らなかった からである。 簡便に光軸が調整できる光学系の構 築とその安定化の実現の困難さがわかったのはか なり後のことである.

このような経緯のもとに独立行政法人産業技術 総合研究所(産総研)のレーザー計測の専門家に 共同研究を依頼し,議論の末にようやく光学系を 完成させた.議論で明らかになった基本的な考え 方は,(1)基本モードの断面形状が最もガウス分 布に近い He-Ne レーザーを用いること,(2)堅 牢で面積の大きな光学架台を用いること,(3)光 学架台上の光路長はできるだけ長く取りレーザー 径の安定化を図ることであった.

(1) に関し、当初はレーザーダイオード(波長 660 nm)を光ファイバーに結合させクライスト ロンギャラリーから加速器トンネル内へ誘導する 方式を試作した⁴⁾.ファイバーから出射したレー ザーを球面ミラーと平面ミラーを組み合わせた反 射光学系を340×162 mm²の大きさの架台上に 搭載し光軸管への入射を試みた.約80 m 長のセ クター C でテストした結果,レーザー径の縦横 比が想定以上に大きいこと,さらに光軸管を真空 にしてもレーザー光軸の充分な安定度が得られないことがわかった.これは、ファイバーの切断面が一様ではなかったこと、架台が小さく軽量すぎて堅牢ではなかったことなどが起因している.さらに、He-Neレーザーをファイバーに結合させることも検討したが、ファイバーに対する安定かつ高い入射効率を維持することがレーザー管の熱変形により困難であろうとの結論に至った.

このような考え方を基に構築したのが C5 ライン用のレーザー光学系(図4)である.

He-Ne 管とその光学系を市販の光学定盤(1500 × 900 × 112^t mm³)上に並べ大気雰囲気中でトンネル床面にこれを設置した.温度や気圧などの環境要因の変化に起因する空気の流れの擾乱を極力抑制するために光学系全体をアクリルカバーで覆い, さらにその上からビニールシートを被せた.

架台床面(1500×500×1750^t mm³)は、ト ンネル床面とは100 mmの間隙をあけて縁切り され、地中には1本のPHC 杭(深さ5 m、外径 450 mm)を打ち込んでいる.これは、日較差に よる建屋変形に起因する床面変動の影響を直接受 けないようにするためである.この架台床面に 20 mm 厚の鉄板を打ち込み剛性の高い鉄架台を 固定し、この上に光学定盤を固定した.このよう に架台全体を堅牢にしたことで光軸を初めて安定 化させることができたのである.

レーザーの伝送には幾つかの球面平凸レンズと 反射ミラーを組み合わせて屈折光学系を構築した.構築した光学系はスプリッターを用いてレー ザーを分岐し異なる光学系を伝送できるようにし ている.このことで二種類の異なる径をもつレー



図4 光学架台上に配置されたレーザー光源と光学シス テム. PBS: 偏光ビームスプリッター, BD: ビー ムダンパー.

ザーを個別に生成することができる. 一つは本シ ステムで用いる細径レーザー(赤線)であり、他 はフレネルレンズ方式アライメント用の太径レー ザー(青線)である.後者は開発途上なので本シ ステムでは用いないが、後章で少し触れることに する. He-Ne 管の出射口から 100 mm 後のレー であり,発散角度は $\theta_x \simeq \theta_y \simeq 0.7$ mrad である. 5 枚の球面平凸レンズ(焦点距離:f=50, 150, 300, 1500, 5000 mm) によりレーザー径は徐々 に拡大され光学系終端のレーザー径は $W_r \simeq W_r \simeq$ 29 mm (図8a) である. この結果, 管から終端 までの伝送距離は~5.5mとなった. このような 比較的長い伝送距離でレーザー径を徐々に拡大さ せれば,局所的に生じる空気の流れの擾乱や光学 レンズの振動といった外乱に対するレーザー径の 安定性をより高めることができる. 入射レーザー の焦点距離は、f5000 レンズを光軸方向に動かす ことで調整することができる.

光学系で生成されたレーザーは,真空に引かれ た光軸管に入射しレーザー長基線として 500 m 長の光軸を形成する(図5).光学系直後と入射 器終端には光軸の基準点を決める QPD が床面に 固定されている.すなわち,光軸は 2 台の基準 QPD の中心を通過するよう調整される.光学系 直後の QPD を始点 QPD (z=6.3 m)と呼び,入 射器終端の QPD を終点 QPD (z=500 m)と呼ぶ. このように長基線を光軸として調整すれば加速ユ ニットの変位を機械的に調整することができる.

2.4 光軸のフィードバック制御

光軸の入射調整は、始点 QPD に対する平行移動と終点 QPD に対する入射角度の調整により行う. 光学系最終段に位置する平行平板(反射防止 膜付,厚さ20 mm,直径 150 mm)の屈折を利用して平板を水平(x)又は垂直(y)軸の回りに 回転させれば光軸の平行移動(角度は変化しない)



図5 レーザーアライメントの概念図. アライメント 前の加速ユニットの配置と形成されたレーザー光 軸.

が可能となる. この原理に基づき光軸が始点 QPDの中心に一致するように平行平板を手動で 回転させる. 一方, 球面平凸レンズの屈折を利用 して光学系最終段に位置する f5000 レンズ(BK7, 反射防止膜付, 直径 100 mm)を x 又は y 軸方向 に平行移動させれば光軸の入射角度の調整(平行 移動はしない)が可能となる. この原理に基づき 光軸を終点 QPD の中心に合わせる. 光軸の角度 調整は計算機によるフィードバック(FB)制御 が可能である. 光軸調整は, 始点及び終点 QPD に対し何度かこの操作を繰り返すことで行われ る.

堅牢な光学系を構築した後、光軸の安定性を測 定したところ、(1) レーザーのポインティング不 安定性に起因すると考えられる速い変動(秒の オーダー), (2) 不規則な変動, (3) 30 分毎の変 動, (4) 日較差を要因とする変動, そして, (5) これらより遥かに長い時間の変動が見られた.当 初は(1)の変動を危惧したが、幸いにもこの変 動は大きくないことがわかった。(2) は環境要因 のわずかな変動に伴う空気の流れの擾乱が起因し ていると考えられる. (3) は空調のオンオフ制御 によることがわかり停止したところ消失した.(5) に関しては原因を特定できていない(3.4節で述 べる). ここに至り初めて計算機による FB 制御 の導入を検討せざるを得なくなったのである.検 討の結果,(1)の変動要因を省けば光軸の変動は ゆっくりしており単純な計算機 FB 制御で安定化 が充分可能であることがわかった.

図6にレーザー光軸の入射角度を安定化させる ための FB 制御システムを示す.

終点 QPD から出力する 4 つの光電流信号は検 出器の信号処理回路に入力される.信号処理回路 では抵抗(10 kΩ)により電流信号が電圧信号に



図6 レーザー光軸の入射角度を安定化させるための フィードバック制御システム.

変換されアナログ演算回路に入力される。4 信号 のアナログ演算により光軸の QPD 中心に対する 変位に比例した水平又は垂直信号が電圧として出 力される⁴⁾. 出力信号はデジタルオシロスコープ に入力され電圧値が計測される. 測定ノイズを低 減させるためにオシロスコープ上で平均操作 (100回)を行い、あらかじめ測定した感度係数 を乗じて終点 QPD 中心に対する光軸のx又はy 位置が演算される. オシロスコープ上の光軸デー タは、LAN を通じて FB 制御用 PC に 3 秒毎に送 信される. PC 上では f5000 レンズ用ステージの 移動量が計算され RS-232C を通してコントロー ラが制御されステージが移動する.一連の計測と ステージの移動量は FB 制御により終点 QPD 中 心に光軸が常に一致するように自動で制御され る. 制御パラメータは、一回に進むステージ移動 量と光軸位置の測定回数である. これらは FB 制 御が安定に動作するように実験的に調整された. 光軸の自動制御機構を導入したことで光軸がよう やく安定化された.

ここで f5000 レンズ用ステージについて触れ ておく. 光軸の入射角度を安定化するには少なく とも 0.2 µrad 以下の安定度が必要となる. これ を実現するには、さらに1桁小さな分解能でス テージを微細に制御する必要がある. すなわちス テージには少なくとも 20 nrad 程度の分解能が要 求される. 開発当初はS社のピエゾステージを採 用した. このステージはピエゾ素子により直接的 に駆動される. ピエゾ素子の駆動分解能(100 nm/step) は充分であったが、動作中はまるで豆 腐のように不安定な振らつきが見られステージ自 体を安定化させることができなかった. そこで最 終的に採用したのが Newport 社のピコモーター 付ステージ(M-562-XYZ⁵⁾)である. このピコモー ターは、シャフトをピエゾ素子で擦るようにして 回転させる.従って駆動停止時の安定度はピコ モーターの機械的構造で決まり、しっかりとス テージ位置を保持するので安定性が低下すること はない. ピエゾ素子の駆動分解能は 30 nm/step で充分である.ただし欠点は、摩擦力でシャフト を回転させるため駆動毎にしばしば数ステップ程 度の滑りがあることである。この程度であれば実 用上の問題はない. このステージの上に f5000 レンズを搭載し, x又はy軸方向に平行移動させ ることで光軸の入射角度に対する終点 QPD での 位置感度係数を計測した. 図7a, bにx, y方向 の位置感度係数の測定結果をそれぞれ示す. x (y) 軸方向の位置感度係数は 0.9 (0.37) μm/step で ある. これは角度感度係数に焼き直すと 1.8 (0.73) nrad/step に相当する. この結果は,要求 される光軸の角度安定度 0.2 μrad に対し入射角 度が x (y) 軸方向に約 110 (270) 倍の分解能で 制御可能なことを示す.

本光学システムは, *x*, *y*軸方向に対称な屈折光 学系を構成するので,位置感度係数も対称になる べきである.しかしながら,測定結果によると約 2.5倍の違いが生じた.これは,屈折光学系を構 成する球面平凸レンズ群のアライメントや各レン ズの曲率半径の不均一性等がその要因として想定



図7 レーザー光軸の終点 QPD における a:水平感度 係数とb:垂直感度係数の測定結果.

8 J. Particle Accelerator Society of Japan, Vol. 10, No. 4, 2013 - 232 -

されるが,明らかな要因の特定には至っていない.

しかし,得られた感度係数は,要求される光軸 安定度を充分小さなステップで制御可能なことを 意味している.これでようやく準備が整った.

3. レーザー光軸の安定化

3.1 光軸の伝送特性

光軸方向のレーザー径の変化は、光軸の変位に 対する QPD の感度を決める重要なパラメータで ある. QPD の感度を向上させるにはできるだけ 小さなレーザー径で照射するのが望ましい. しか し、ガウスレーザー光学に従うと光学系出口で入 射径を決めれば伝送途中のレーザー径の変化はウ エスト点を除いて物理的に決まってしまう. ウエ スト点は、光学系の焦点距離を調整すれば決まる.

QPD の感度をできるだけ一様にするために光 軸に沿うレーザー径の変化はウエスト点を中心と して対称的にするのが望ましい. f5000 レンズを 光軸方向に平行移動させながら,終点 QPD にお けるレーザー形状を CCD カメラで取得し画像処 理を施すことでレーザー径を計測した. この調整 により終点 QPD における *x*, *y* 方向のレーザー径 はそれぞれ $W_x \simeq 21.2$ mm, $W_y \simeq 17.8$ mm であっ た. 得られたレーザー形状を**図 8b** に示す.

光学系出口のレーザー形状は真円に近いが(図 8a),終点 QPD のそれはやや楕円形状である. これはミラーやレンズの曲率の不均一性が原因で あろうと思われる.しかし,レーザーコアーはガ ウス形状に近く強度重心の測定には問題ない程度 である.

伝送途中のレーザー形状を直接的に観測するこ とは困難であるが,感度校正用の可動 QPD(光 軸に垂直な平面上で機械的に可動する)がセク ター毎に挿入されている.これを利用すれば QPDの感度測定からレーザー径を推定できる⁴⁾. 測定された軸方向に沿うレーザー径の変化を**図 9** に示す.

入出力端のデータ(三角印)は CCD による直 接測定を示し、伝送途中のデータ(丸印)は QPD の感度測定の解析に基づく.ガウスレーザー の伝送光学によると以下に示す関係式で光軸(z 軸)に沿うレーザー径の変化を記述することがで きる⁶.

$$W_{x}(z) = W_{x0} \sqrt{1 + \left(\frac{z - z_{x0}}{z_{Rx}}\right)^{2}}$$

ここで W_x (*z*) は軸方向に沿う *x* 方向のビーム径, W_{x0} はウエスト点 (*z* = *z*_{x0}) におけるビーム径, *z*_{Rx} はレーリー長をそれぞれ示す. *y* 方向のビーム 径も同様に記述できる. 最小自乗法からこれらの



図8 CCD カメラで取得したレーザーの強度分布. a:z = 0 m (光学系出口), b:z = 500 m (終点 QPD). スケールバーは 5 mm.



図9 光軸に沿った水平・垂直方向のレーザー径の変化. 水平・垂直データ点はお互いの重なりを避けるために軸方向に少しずらしてプロットしている.

パラメータを解析したところ、x(y)方向のレー リー長は z_{Rx} =308 m (z_{Ry} =321 m) となり、ウエ スト点 z_{x0} =358 m (z_{y0} =399 m) におけるレーザー 径は $W_x \simeq 18.8$ mm ($W_y \simeq 18.0$ mm) であった. 得られた結果は調整不足のため対称的とは言いが たいが実用上の問題はない.

3.2 光軸の安定性特性

FBの制御パラメータを最適化した後,始点と 終点 QPD 中心に光軸を調整し FB を動作させて 光軸安定化の連続試験を行った.図10に FB ON/OFF 時の連続試験の結果を示す.

この結果から FB 制御の効果が一目で理解でき るであろう.ここで注意したいのは,FB 制御は あくまでもゆっくりとした光軸変動の安定化に効 果があり,速い変動には追従できていないことで ある.これは FB 速度が光軸データの取得時間で 制限されることに起因する(3 秒毎).その証拠 に FB 制御の ON/OFF に関わらず速い変動(変 動線の太さ)は改善されていない.データ取得時 にはレーザー強度も同時に取得されるが強度変動 は 5%程度である.この強度変動がレーザーのポ インティング安定性を決めており,光軸の速い変 動はこのことによると考えている.

図 11 に FB-ON 時の連続試験の結果を示す. このデータを分布図に焼き直した結果を図 12 に 示す.分布図の幅から光軸の安定性を推定するこ とができる.光軸の変動はほぼガウス分布をして いるので光軸のポインティング安定性は統計的な



図 10 終点 QPD における x, y 軸方向の光軸変位の時間 変化.前半は FB-ON(4時間),後半は FB-OFF (9.5時間).



図 11 FB-ON 時の終点 QPD における *x*, *y* 軸方向の光 軸変位の時間変化(8時間).

要因に基づくと考えてよい. この測定からx(y)方向の光軸の位置安定性は,ガウス分布と仮定して平均位置は測定限界以下の変位である. 一方,標準偏差によるx(y)方向の変位に対し $\sigma_x=33 \mu m(\sigma_y=41 \mu m)$ が得られた. 角度安定性に焼き直すと $\sigma_{\theta x}=66 nrad(\sigma_{\theta y}=82 nrad)$ に相当する. 得られた安定度は入射器に要求されるアライメント精度を充分満足している. なお,3日間を越える FB 制御の連続試験でも一切の調整なく同様な光軸の安定度が達成された.

3.3 レーザーアライメントの誤差評価

レーザーアライメントには、光軸安定度を決め る統計誤差の他に幾つかの系統誤差を伴う.ここ では想定される誤差要因をまとめ、レーザーアラ イメントに伴う誤差を評価する.

光軸の変位を測定する QPD の設置位置は系統 的な誤差要因となる.専用のサブホルダー中心に 装着された QPD は,そのホルダーが加速ユニッ ト端面にフランジを介して装着される.テストベ ンチ校正において QPD は,サブホルダー中心に QPD 中心が一致するように装着される(QPD 装 着誤差)³⁾.加速ユニットに対する QPD ホルダー の装着は,嵌め合い公差で決まる(ホルダー装着 誤差).これらは QPD の装着に関わる機械的誤 差である.さらに測定時の QPD は光軸ラインへ 蝶番を通して手動で挿入される.挿入時の直立位 置の再現性(QPD 挿入誤差)が機械的な誤差要 因となる.



図 12 FB-ON 時の終点 QPD における a: x 軸及び b: y 軸方向の光軸の変位分布.

加速ユニットの変位測定時は QPD 検出器の電 気的オフセットが誤差要因となる(オフセット誤 差). さらにレーザー形状のガウス分布からのず れは光軸の強度重心の測定誤差となる(レーザー 形状誤差). 以上がレーザーアライメントに関わ る系統的な誤差要因である.

ここで QPD 検出器について少し触れておく. アライメント時は,AB 及び C5 ラインに各4台 の検出器が使用される.各ラインの始点(光軸監 視用)と終点(光軸FB用)に各1台を置き,加 速ユニットのアライメント計測用に2台を使用す る.各ラインの同時作業を想定して全8台の検出 器を保有している. QPDの4つの光電流は信号処理回路の抵抗(10 kΩ)により電圧に変換され、後段のアナログ演 算回路で水平及び垂直信号が出力される⁴⁾.4つ の抵抗値のばらつきは、水平及び垂直信号の電気 的オフセットとして誤差要因となる.この抵抗に は通常の金属皮膜抵抗(精度1%,温度係数50 ppm)を用いている.しかし、これでは精度不足 なので抵抗値を揃えるために約千個の中から選別 を行い、抵抗値が±0.02%以下の精度で一致す るように厳密に選別した.このようにして全8台 の QPD 検出器が改修されたのである.

レーザーアライメントに関する誤差要因は系統 的な誤差要因を含め全て実測により検証された. 本論文で議論した光軸安定性を統計誤差とし,実 測した系統的な誤差要因とその大きさを**表2**にま とめる.

系統誤差を自乗和平方根により合計すると 46μmとなる.このように系統誤差を考慮しても レーザーアライメントの精度は要求精度を充分満 足することを検証した.

検証されたレーザーアライメントの精度は要求 精度に対し少し余裕をもたせている.この余裕が レーザートラッカーによる短距離アライメントに 与えられる許容誤差となる.短距離アライメント の誤差要因をここで述べることはしないが,アラ イメント全体の誤差は,短距離アライメントの誤 差要因を考慮しても要求精度を満足することを検 証している.

3.4 FB 動作中のステージの動き

ここで議論しておきたいことは FB 動作中のス テージの動きである.データ取得時には f5000 レンズ用ステージの動きも同時に取得している. 図 13 に 2013 年 3 月 4 日から 29 日までの FB 動 作時に取得されたステージの位置変化を示す.途

表2 レーザーアライメントにおける誤差要因の評価

種類	要因	誤差 [μm]
系統誤差	QPD 装着誤差	10
	ホルダー装着誤差	30
	QPD 挿入誤差	30
	オフセット誤差	12
	レーザー形状誤差	10
	合計(自乗和平方根)	46
統計誤差	光軸安定性	40

中で何度かステージのオフセット調整をしている が,ステージの動きを見ると*x*(*y*)方向に概ね 380 (830) μm/day の割合で特定の方向に変位 し続けていることがわかる.

x (y) 方向のステージの動きは光軸の進行方向 に対し常に東側(天井側)を向いている.当然の ことながら,FB動作中の光軸は終点QPD中心 に常に一致するように安定化されている.光軸の 感度測定の符号に従うと光軸の動きもステージと 同じ符号で変位していることを意味する.ステー ジの変位に感度係数を乗じると終点QPDにおけ る光軸変位の補正量に焼きなおすことができる. その変位の速さはx (y)方向に概ね11(10)mm/ dayに対応するが,この補正量は非常に大きい.

このことを確認するために3月16日から3月 17日にかけて再度光軸を調整した後,同様にFB を動作させて連続測定したがステージの変位は折 り返すことなく同様な変位の速さで推移した.こ のとき,光学系近傍の環境パラメータも同時に測 定したが明らかな相関を見いだせなかった.この 間に取得した環境パラメータの測定値は,トンネ ル温度の変化:22.5±0.5℃,湿度の変化:29 ±20%,気圧の変化:1005±15hPaであった. さらにタリベル傾斜計を用いて光学架台の変動も 同時に計測したが傾斜変動は計測限界(1µrad) 程度であった.

He-Ne 管の熱変形に伴う光軸の入射角度の変 動も疑われ,管自体を 90 度又は 180 度回転させ



図 13 2013 年 3 月 4 日から 29 日までの FB 動作時に 取得されたステージの x 及び y 方向の位置変化.

て光軸変動を連続測定した. もし管の熱変形が原 因であれば,光軸変動の向きが入れ替わるはずで ある. しかし,この測定にも関わらず明らかな相 関を見いだせなかった. この現象が 2.4 節で述べ た光軸の長時間変動のことである. 残念ながら現 時点ではこの現象の要因を特定するには至ってい ない.

クライストロンギャラリーと加速器トンネルが 一体となった8つの建屋を7箇所のジョイント で接続した総長 500 m の建屋の地下トンネルに, 入射器本体は設置されている。各建屋の膨張収縮 はジョイントである程度吸収されるが、吸収され ない分は建屋全体の変形となりトンネル床面を動 的に変動させることになる. 仮に各建屋が独立に 変形すると測定基準となる QPD 自体が動的に変 位することになる. このことにより, FB 制御に より一見安定化された光軸が実は動的に変動して いる可能性が考えられる. もしこのことが本当で あればアライメント自体が意味を成さなくなる可 能性があり大きな問題を投げかけている. QPD の駆動を全自動化し光軸の連続測定を行えばこの 問題に対するヒントが得られると思われるが今後 の課題としたい.

4. 今後の課題

本研究により 500 m 長レーザー長基線の高安 定化が実現され入射器の高精度アライメントの準 備が整った、システム全体の開発に携わることで わかったことであるが、本システムは入射器の初 期アライメントとしては有効であるが恒久的には 余り優れたシステムとは言い難い、これは、ビー ムラインのすぐ側に多数の QPD が設置されるの で、放射線損傷が大きければ四分割された各素子 のゲインにばらつきが生じ測定精度を低減させて しまう恐れがある. これには、QPD ゲインを常 にオンラインで監視すればよいが総計200ヶ近 くの監視システムの構築は予算的にも容易なこと ではない. さらに QPD 自体が透明ではないので, 加速ユニットの計測時には光軸が遮られる. 従っ て、この間 FB 制御を停止させる必要があり、光 軸の高安定化が損なわれてしまうことになる.

このことから、レーザーアライメントシステム を恒久的に使用するには耐放射線性の高いシステ ムが望まれる.SLACのレーザーアライメントシ

ステムは、このような要求を満足する優れたシス テムである⁷⁾. SLAC 線形加速器の架台は、入射 器と同様な 12.192 m 長の円筒パイプ (アルミ, 直径 609.6 mm) からなる. 1 セクターは 8 台の 加速ユニットからなり、総計240台の架台が設置 される. 全30セクターから構成される電子陽電 子線形加速器の総長は3kmである. SLACでは円 筒パイプ自体が光軸管になっており、

架台両端に は正方形型のフレネルレンズ (1辺 355.4 mm) が 装着されている. この方式では、レーザーは直接 的な光軸とはならない、入射器のような細い平行 ビームではなく、複雑な光学系を用いないでレー ザー管から直接光軸管にレーザーを入射してい る. この結果、レーザーは発散ビームとなりレン ズ全体に照射される.フレネルレンズはレーザー を集光し3 km 終端で鋭い集光点を作る. この集 光点がアライメントの基準点となる.加速器に 沿った始点、中間点及び終点に床面から同様なレ ンズを設置し、終端に作られる3つの集光点を一 致させることでアライメントの長基線が形成され る. この長基線を光軸として加速ユニットの変位 が計測されることになる. このように, SLAC 方 式ではフレネルレンズは受動素子として用いられ るので放射線損傷の恐れがほとんど無い. さらに レーザーは終端から入射され、集光点の計測に利 用する CCD カメラは電子銃の上流に設置されて いる. このような計測機器の配置は放射線損傷の 恐れを著しく低減させる.また、レンズに照射さ れるレーザーの波面は球面波なので、光軸が多少 変動したとしても集光点の変位は高次の項が寄与 するだけなので、光軸安定化のための特別な FB 制御を必要としない.

このような SLAC 方式は,システム自体が極め て高い耐放射線性と安定した光軸をもつ恒久的な システムと言える.欠点としては,KEKB 入射器 に比べ口径の大きな円筒架台を真空に引く必要が あり真空システムがより大きくなること,また, レンズの焦点距離は架台位置に応じて固定される ので,架台位置を任意に変更することが困難であ ることが上げられる.しかし SLAC 方式は,この ような欠点にも関わらず優れた方式だと考える. 我々も入射器の恒久的なレーザーアライメントシ ステムとして SLAC 方式を利用すべく原理実証実 験を開始した⁸⁾.

5. まとめ

筆者等は、レーザー光学系を新たに構築し、さ らに計算機制御によるフィードバックを導入する ことにより高精度レーザーアライメントに必要な 500 m 長レーザー長基線の安定性を飛躍的に高め ることに成功した.得られた光軸の安定度は標準 偏差で40 µm(1σ)レベルである.これは角度 安定性に焼き直すと80 nradに相当する.本成果 は次世代の長距離線形加速器にも応用可能な技術 であり、ダム事業やトンネル構築など高精度な長 基線を必要とする大規模土本事業への貢献も期待 できる.

本研究は,佐藤政則准教授(KEK 加速器),寺 田聡一主任研究員(AIST 計測標準計測部門)と の共同研究により行われました.

謝 辞

本研究の遂行にあたり, KEK 加速器研究施設

の菅原龍平名誉教授と同施設長生出勝宣教授には 有益な御議論を頂きました.また,理化学研究所 の松井佐久夫博士と高輝度光科学研究センターの 木村洋昭博士には,多大なる協力と御意見を頂き ました. 深く感謝を申し上げます.

参考文献

- Y. Ohnishi, et al.: Prog. Theor. Exp. Phys. (2013) 03A011.
- M. Akemoto, et al.: Prog. Theor. Exp. Phys. (2013) 03A002.
- 3) K. Hisazumi, et al.: Proceedings of the 8th PASJ, Tsukuba, Aug. 1-3, 2011, pp.771-775.
- T. Suwada, M. Satoh and E. Kadokura: Rev. Sci. Instrum. 81, 123301 (2010).
- 5) http://www.newport.com for Newport
- 6) A. E. Siegman: Lasers (University Science Books, California, 1986), p. 665.
- R. B. Neal (ed.): The Stanford Two-Mile Accelerator (W. A. Benjamin, New York, 1968), pp. 821-885.
- 8) T. Suwada, M. Satoh, S. Telada and K. Minoshima : Rev. Sci. Instrum. **83**, (2012) 053301.